## Термопрограммируемый синтез монокристаллов квазисвободного N-графена из молекул ацетонитрила

С. Л. Коваленко, Т. В. Павлова, Б. В. Андрюшечкин, К. Н. Ельцов<sup>1)</sup>

Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, 119991 Москва, Россия

Поступила в редакцию 15 апреля 2020 г. После переработки 16 апреля 2020 г. Принята к публикации 16 апреля 2020 г.

На поверхности Ni(111) реализован оригинальный термопрограммируемый рост монокристаллов азотированного графена размером с подложку. Технологический процесс включает в себя адсорбцию ацетонитрила при температуре около -10 °C, флэш-прогрев образца до 140 °C, отжиг при 400 °C для образования сплошного эпитаксиального монослоя углерода со структурой графена. Интеркаляция золота под слой углерода на поверхности Ni(111) приводит к формированию квазисвободного монокристалла N-графена. Для определения структуры азотных центров в графене использовалась сканирующая туннельная микроскопия совместно с расчетами на основе теории функционала плотности. В частности, установлено, что азот может входить в решетку графена как в виде отдельных атомов, так и виде кластеров из двух и трех атомов. Концентрация азота в графене может составлять от 0.2 до 0.6 %.

DOI: 10.31857/S1234567820100092

В настоящее время наблюдается бум исследований в области двумерных материалов, начало которому было положено работами по отщеплению и исследованию монослоев графена и других соединений, проведенными А. Геймом с соавторами [1–3]. По прошествии более 15 лет семейство двумерных материалов существенно разрослось вплоть до самых экзотических предложений [4], появились промышленные технологии синтеза (см., например, [5] и ссылки внутри), но вопрос о создании двумерных кристаллов большого размера (1 см и более) остается актуальным. Помимо технологий синтеза чистых материалов необходимо также иметь методы контролируемого легирования для управления электронной и атомной структурой указанных материалов.

В этой связи, и в первую очередь для графена, активно развиваются методы легирования материалами III и V групп таблицы Менделеева. Наиболее используемой легирующей примесью является азот. Разделяют два подхода. Первый – легирование уже имеющегося чистого графена или его оксида. Здесь используется ионная имплантация, температурная и/или плазменная обработка в атмосфере азотсодержащих газов и т.п. Второй подход – синтез азотированного графена непосредственно из азотсодержащих углеводородов или из смеси углеводородов и азотсодержащих молекул (прекурсоров). Среди описанных в литературе методов синтеза азотиро-

В данном Сообщении предлагается метод синтеза однослойного N-графена, позволяющий выращивать монокристаллы размером с подложку. За основу выбран метод термопрограммируемого роста (TPG – thermoprogrammed growth), использованный нами для создания монокристаллов большого размера нелегированного графена на поверхности Ni(111) [7,8]. Суть метода ТРС заключается в разделении двух стадий процесса синтеза: при комнатной температуре проводится экспонирование поверхности металла молекулами углеводородов, после чего газовая фаза снимается и образец отжигается в сверхвысоком вакууме. При использовании молекул пропилена метод TPG позволил создать на поверхности Ni(111) эпитаксиальный монослой углерода с атомной структурой графена, который после интеркаляции золота становится практически бездефектным монокристаллом квазисвободного графена размером с подложку [8].

Как было установлено в работе [7], необходимым условием для синтеза высококачественного нелегированного графена методом TPG является аккумулирование достаточного количества углерода в приповерхностной области Ni(111) при температурах ниже температуры образования карбида никеля. Для формирования N-графена к этим условиям добавляется требование наличия

ванного графена (см. [6]) ни один не позволяет создавать большие монокристаллы азотированного графена (N-графена).

 $<sup>^{1)}</sup>$ e-mail: eltsov@kapella.gpi.ru

азота на поверхности Ni(111) в процессе синтеза графена.

Ацетонитрил (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>N) был выбран нами на основе следующих соображений. Во-первых, для TPGпроцесса требуется линейная азотсодержащая молекула углеводорода, потому что предполагается дегидрирование (на атомных террасах) и даже диссоциация (на краях атомных ступеней) молекулы уже при комнатной температуре аналогично поведению пропилена на поверхности Ni(111) [7-9]. Ароматические азотсодержащие молекулы типа триазина или пиридина, обычно используемые для CVD-синтеза графена [6], не подходят. Во-вторых, при дегидрировании или диссоциации молекулы атомы азота должны оставаться на поверхности никеля при температурах формирования графена. При изучении адсорбции ацетонитрила на поверхности Ni(111) авторами [10, 11] установлено, что половина молекул ацетонитрила десорбируется в молекулярной форме при температурах ниже 130 °C, причем основной пик в спектрах термодесорбции имеет максимум при 80 °C. Вторая же часть частично дегидрируется и трансформируется в азотсодержащие соединения, достаточно сильно связанные с поверхностью [11]. Термический выход водорода наблюдается при температурах 130–150 °C. При дальнейшем нагревании, при температуре около 530 °C, азот полностью удаляется с поверхности Ni(111), а углерод либо остается на поверхности, либо уходит в объем кристалла [11].

В соответствии с выявленными особенностями в поведении ацетонитрила на поверхности Ni(111) нами была разработана и апробирована процедура формирования эпитаксиального монослоя графена с включенными атомами азота. Для формирования квазисвободного N-графена, так же, как и в случае нелегированного графена, в интерфейс между эпитаксиальным слоем C(N) и поверхностью Ni(111) вводилось золото [8, 12].

Все технологические операции, анализ структуры и состава поверхности реализованы в единой сверхвысоковакуумной установке, оснащенной электронным оже-спектрометром (ЭОС) ОРС-200 RIBER, дифрактометром медленных электронов (ДМЭ) OPC-304 RIBER, сканирующим туннельным микроскопом (СТМ) GPI300 SigmaScan (http://www.sigmascan.ru/index.php/en/menuuhvstm-2), квадрупольным масс-спектрометром Q156 RIBER, ячейками напыления, системой напуска газов, системой прогрева образцов и кварцевым измерителем толщины.

При исследовании поверхности в CTM использовались как платиново-родиевые иглы, так и

поликристаллические вольфрамовые иглы. СТМизображения записывались при комнатной температуре. В качестве подложки взят монокристалл никеля  $6 \times 6 \times 2$  мм (Surface Preparation Laboratory https://www.spl.eu), рабочая поверхность которого ориентирована в плоскости (111) с точностью 0.1°. Для получения атомно-чистой монокристаллической поверхности и обеднения приповерхностной области углеродом использовались циклы ионного травления (Ar<sup>+</sup>, 1 кэВ, 0.1 мкА, 15 мин) и отжига (320 °C, 10 мин). В последнем цикле очистки отжиг проводился при температуре 600 °C. Критерием необходимой чистоты поверхности являлось отношение интенсивностей оже-пиков остаточных загрязнений (C, S) к оже-пику Ni  $L_3M_{4.5}M_{4.5}$ , равное 0.01. При этом картины ДМЭ поверхности демонстрировали четкие пятна дифракции, а СТМ-кадры – обширные террасы, разделенные одноатомными ступенями. Поток молекул ацетонитрила подавался непосредственно на образец через 2-миллиметровый капилляр. Давление в пучке тонко регулировалось пьезокерамическим натекателем в диапазоне  $10^{-5} - 10^{-9}$  Торр.

Анализ атомных структур, полученных при СТМ-измерениях, проводился на основе теории функционала плотности. Спин-поляризованные вычисления были выполнены в программном пакете VASP [13, 14]. Использовались обобщенное градиентное приближение (GGA) и обменно-корреляционный функционал РВЕ [15] с учетом ван-дер-ваальсовых взаимодействий по методу Гримме [16]. Поверхность Ni(111) моделировалась периодически повторяющимися гексагональными ячейками 6 × 6, состоящими из четырех атомных слоев никеля, из которых нижние два были фиксированы. Ячейки были разделены вакуумным промежутком в 17 Å. Атомы углерода и азота помещались на верхнюю часть ячейки и могли релаксировать в процессе вычисления. Атомы углерода в структуре графена на поверхности Ni(111) располагались в положениях над атомом никеля (on top) и г.ц.к. положениях (fcc). В расчетах использовалась сетка k-точек  $6 \times 6 \times 1$ . СТМ-изображения были построены в программе HiveSTM [17] в рамках приближения Терсоффа–Хаманна [18].

Энергия формирования азотных центров вычислялась по следующей формуле:

$$E_f = E_{\rm def} - (E_{\rm Gr/Ni} - V_{\rm C}E_{\rm C} + N_{\rm N}E_{\rm N}),$$

где  $E_{\rm def}$  – полная энергия графена с азотным центром (дефектом) на поверхности Ni(111),  $E_{\rm Gr/Ni}$  – полная энергия бездефектного графена на поверхности Ni(111),  $V_{\rm C}$  – число вакансий углерода в графене,

 $E_{\rm C}$  – энергия одного атома углерода в бездефектном графене на поверхности Ni(111),  $N_{\rm N}$  – число атомов азота в графене,  $E_{\rm N}$  – энергия одного атома азота, адсорбированного на поверхности Ni(111). Энергия  $E_{\rm C}$ вычислялась как разница полной энергии графена на поверхности Ni(111) ( $E_{\rm Gr/Ni}$ ) и чистой поверхности Ni(111) ( $E_{\rm Ni}$ ), деленная на число атомов углерода в суперячейке графена ( $N_{\rm C}$ ):

$$E_{\rm C} = (E_{\rm Gr/Ni} - E_{\rm Ni})/N_{\rm C}$$

При вычислении энергии  $E_{\rm N}$  атом азота помещался на поверхность Ni(111) в г.ц.к. положение, являющееся наиболее выгодным адсорбционным положением отдельного атома азота на Ni(111) [19]. Отметим, что при формировании графена методом TPG, атомы азота перед встраиванием в графен находятся на поверхности Ni(111), поэтому мы берем энергию адсорбированных атомов азота, а не энергию атомов (или молекул) в вакууме. Тогда энергия  $E_{\rm N}$  равна разнице полной энергии поверхности Ni(111) с атомом азота на ней ( $E_{\rm N/Ni}$ ) и полной энергии чистой поверхности Ni(111):

## $E_{\rm N} = E_{\rm N/Ni} - E_{\rm Ni}.$

Процедура TPG-синтеза эпитаксиального монослоя углерода, легированного азотом, включала в себя следующие операции: 1) насыщение приповерхностной области образца Ni(111) углеродом с сохранением чистоты самой поверхности; 2) адсорбцию ацетонитрила при температуре  $\approx -10$  °C дозой 1000– 3000 L (Ленгмюр); 3) быстрый (6–7 град/с) нагрев образца до 140 °C и охлаждение естественным образом ( $\approx -0.5$  град/с) до комнатной температуры; 4) отжиг образца при 400 °C в течение 1  $\div 5$  ч.

Как установлено нами при синтезе нелегированного графена [7,8], насыщенная углеродом приповерхностная область Ni(111) является основным источником углерода для формирования углеродного монослоя на поверхности при высокотемпературном отжиге (500 °C). Такое поведение характерно для синтеза графена на поверхности металлов с высоким коэффициентом растворения углерода в объеме [20]. Для насыщения углеродом приповерхностной области Ni(111) в настоящей работе (аналогично [7,8]) использовался крекинг пропилена на горячей поверхности при температуре 600 °C в течение 10 мин и давлении газа  $1 \cdot 10^{-5}$  Торр вблизи поверхности (D  $\approx 10^4$  L). В результате на поверхности Ni(111) формировался монослой углерода со структурой графена в виде эпитаксиальных и развернутых доменов размерами 10 ÷ 50 нм ("поликристал-

лический графен"). Одновременно происходило насыщение приповерхностной области за счет диффузии атомов углерода в объем кристалла никеля. Для удаления поликристаллического графена с поверхности использовались циклы "травление (Ar<sup>+</sup>, 1 кэВ, 10 мин)/нагрев (10 мин, 600 °C)". Учитывая, что при этой температуре сегрегация углерода проходит гораздо менее активно, чем при 320 °C [21], удавалось достаточно хорошо очистить поверхность Ni(111), сохраняя под ней растворенный углерод. Указанные циклы очистки проводились до тех пор, пока углерод практически полностью не удалялся с поверхности. В результате не более чем 3% площади образца оставалось покрытой углеродом, что соответствовало соотношению pprox 0.02 интенсивностей оже-линий C KLL и Ni  $L_3M_{4,5}M_{4,5}$ . Линия C KLL имела форму, характерную для карбидов, и в СТМ-кадрах углерод (в виде поверхностного карбида никеля Ni<sub>2</sub>C) наблюдался лишь вблизи краев атомных ступеней. Такая подготовка, в основном, предотвращала образование развернутых доменов графена при последующем TPG-синтезе, поскольку в работе [22] показано, что поверх Ni<sub>2</sub>C графен растет с разворотом атомной решетки.

Запасенного таким образом подповерхностного углерода хватало примерно на 8–10 TPG-процессов. Для тестирования запаса подповерхностного углерода мог использоваться отжиг образца при 320 °C в течение 15 мин. Установлено опытным путем, что, если растворенного углерода достаточно, то за 15 мин при температуре 320 °C большая часть (80–90 %) поверхности Ni(111) покрывается Ni<sub>2</sub>C.

Ацетонитрил использовался в первую очередь как источник азота для легирования графена. Для увеличения исходной степени покрытия C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>N адсорбировался на поверхность Ni(111) при пониженной температуре, обычно  $-(5 \div 15)$  °C [10, 11]. Так, после осаждения 2000 L ацетонитрила в ожеспектре поверхности отношение интенсивностей линий N KLL, C KLL и Ni  $L_3M_{4,5}M_{4,5}$  составляло 0.06 : 0.11 : 1.0. С учетом соответствующих коэффициентов чувствительности оже-линий отношение азота и углерода в адсорбированном слое составляло 1 : 2.9, что несколько меньше, чем должно быть в молекуле ацетонитрила (1 : 2). На рис. 1а показано СТМ-изображение поверхности Ni(111), записанное при комнатной температуре после указанной адсорбции. Поверхность никеля оказывается покрытой одномерными цепочками, похожими на цепочки, которые наблюдаются на поверхности Ni(111) [7,9] после адсорбции пропилена. Характерная длина цепочек находится в диапазоне  $15 \div 20$  Å.



Рис. 1. (Цветной онлайн) СТМ-изображения поверхности Ni(111) после адсорбции 2000 L ацетонитрила (a), и после флэш-нагрева (140 °C) и отжига при температуре 400 °C в течение 5 ч (b). Размер кадров 130 × 130 Å<sup>2</sup> ( $U_s = -14 \text{ MB}$ ,  $I_t = 1.4 \text{ HA}$ ). В синих овалах показаны как отдельные центры, так и "гирлянды" никелевых дефектов Ni-V. Желтым, зеленым и белым цветом обведены наиболее часто наблюдаемые азотные центры

В работе [9] нами установлено, что в случае адсорбции пропилена на поверхности Ni(111) энергетически наиболее выгодными являются цепочки типа  $C_nH_n$ . Именно  $C_{12}H_{12}$  наиболее адекватно описывают цепочки длиной 18 Å, наблюдаемые в работе [9]. Поскольку ацетонитрил представляет собой молекулу этана, в которой три атома водорода заменены на атом азота, то можно предположить, что наблюдаемые при комнатной температуре линейные цепочки представляют собой комбинацию из нескольких молекул ацетонитрила, в которых могут отсутствовать как атомы водорода, так и атомы азота. Для более точного анализа атомной структуры цепочек требуется специальное исследование. Тем не менее, нами были смоделированы атомные структуры типа C<sub>n</sub>H<sub>n+3</sub>N, которые оказались устойчивыми при n = 11 и хорошо описывали наиболее часто наблюдаемые цепочки длиной 18 Å.

Флэш-нагрев поверхности, полученной в результате осаждения ацетонитрила, до 140 °C приводил к уменьшению интенсивностей оже-линий углерода и азота. Соотношение интенсивностей N *KLL*, C *KLL* и Ni  $L_3M_{4,5}M_{4,5}$  становилось 0.02 : 0.06 : 1.0 и содержание азота в адсорбированном слое составляло около 20 %.

Третья стадия TPG-синтеза N-графена осуществлялась при минимально возможной температуре 400 °С, чтобы избежать десорбции азота [11]. После 5-ти часов отжига при указанной температуре на поверхности Ni(111) формируется сплошной эпитаксиальный монослой углерода с атомной структурой графена. Соотношение интенсивностей указанных линий в оже-спектре изменилось до 0.006 : 0.38 : 1.0. Линия N KLL становится сравнимой с шумами. Оценочная концентрация азота в углеродном слое составила менее 1%. СТМ-измерения поверхности, проводимые через каждый час отжига, показали, что островки новой фазы с атомной структурой графена формируются и на террасах, и на краях ступеней. Между островками наблюдаются отдельные атомные цепочки, похожие на цепочки, представленные на рис. 1а. По мере увеличения времени отжига происходит рост островков и их агломерация с формированием сплошной пленки со структурой графена.

На рисунке 1b приведен CTM-кадр высокого качества поверхности Ni(111), покрытой сплошным слоем углерода в структуре графена. Отчетливо видны атомные дефекты, часть из которых является атомами никеля, внедренными в бивакансии в решетке графена, так называемые Ni-V центры [7, 23] (обведены овалами синего цвета). Внедренные атомы никеля наблюдаются в виде одиночных элементов и "гирлянд". Помимо атомов никеля на CTMизображении имеются атомные структуры, которые



Рис. 2. (Цветной онлайн) Расчетные модели (верхняя панель), соответствующие им симулированные (средняя панель) и экспериментальные (нижняя панель) СТМ-изображения локальных структур из атомов азота, наблюдаемые в решетке эпитаксиального монослоя углерода, синтезированного TPG-методом из молекул ацетонитрила на поверхности Ni(111). Атомы азота обозначены синим цветом. Сверху над каждым столбцом указаны идентификация модели и рассчитанная энергия  $E_f$ ; цифрами на СТМ-изображениях указаны туннельные напряжения при сканировании и моделировании

мы связываем с внедрением атомов азота в решетку графена.

Нами было рассмотрено большое количество моделей для дефектов с одним, двумя и тремя внедренными атомами азота, замещающих атомы углерода в решетке, как с наличием одной вакансии рядом, так и без вакансий. На рисунке 2 приведены СТМ-изображения экспериментально наблюдаемых локальных атомных структур в решетке графена на поверхности Ni(111), расчетные модели и соответствующие симулированные СТМ-изображения атомных центров из одного и/или нескольких атомов азота. Нам не удалось с достаточной степенью достоверности сопоставить наблюдаемые СТМ-изображения расчетным изображениям для моделей с углеродной вакансией в азотном центре, и, наоборот, на наш взгляд, приведенные на рис. 2 экспериментальные данные для моделей без вакансий неплохо согласуются с расчетными. Отметим, что наиболее часто ложении (1Nfcc), а также центры из двух атомов азота, расположенных либо в одной, либо сразу в обеих подрешетках графена. Также наблюдаются центры из трех атомов азота. Из всех азотных центров на рис. 2 энергия формирования  $E_f$  для центра 1Nfcc является наименьшей, следовательно, его формирование является наиболее выгодным по сравнению с другими. Оценочная концентрация идентифицированных азотных центров в N-Gr/Ni(111) составляет 0.1 %, однако, возможно, что в условиях эксперимента часть азотных центров мы не можем отличить от Ni-V дефектов. В этом случае величина 0.1 % является нижней границей для определения концентрации азотных центров.

наблюдаемыми азотными центрами являются атом-

ные дефекты замещения атома углерода в г.ц.к. по-

Таким образом, показано, что TPG-метод позволяет синтезировать однослойный монокристаллический эпитаксиальный N-графен на поверхности



Рис. 3. (Цветной онлайн) СТМ-изображения: (a) – поверхности N-Gr/Au/Ni(111) ( $U_s = -8$  мВ,  $I_t = 1.2$  нА); (b) – поверхности Gr/Au/Ni(111) ( $U_s = -13$  мВ,  $I_t = 0.2$  нА). Соответствующие Фурье-образы (FT) приведены на вставках в правом верхнем углу. Обозначены рефлексы (00, 10 и 01) решетки графена. На обоих СТМ-кадрах видна сверхструктура петлевых дислокаций, расположенных в верхнем слое Ni(111), которая, в частности, проявляется в Фурье-образе нелегированного графена вокруг каждого рефлекса и особенно отчетливо для рефлекса (00) (b). Стоячие электронные волны, наблюдаемые в (a), формируют структуру  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ –30°, рефлексы от которой на FT обведены синими кружками. Буквами на (a) обозначены типы центров рассеяния, центр В показан в виде вставки в правом нижнем углу (a)

Ni(111). Однако сильное взаимодействие с подложкой (гибридизация *п*-состояний графена и *d*-состояний никеля) разрушает уникальные свойства, характерные для свободного графена. Одним из способов для восстановления электронных свойств графена (линейной дисперсии в К-точке зоны Бриллюэна) является интеркаляция монослоя золота в интерфейс Gr/Ni(111) [8,12]. Для формирования слоя золота в интерфейсе N-Gr/Ni(111) мы предварительно напыляли золото на поверхность N-Gr/Ni(111) при комнатной температуре, после чего осуществлялся прогрев при 450 °C в течение 10 мин. Количество напыляемого золота контролировалось кварцевым измерителем толщины. Критерием вхождения золота в интерфейс N-Gr/Ni(111) является возникновение структуры треугольных петлевых дислокаций, характерной для системы Au/Ni(111) [24], которую принципиально можно наблюдать в СТМ-изображениях графена поверх Au/Ni(111) [8]. Наблюдение сплошной атомной решетки графена, под которой располагается сеть треугольных петлевых дислокаций в верхнем атомном слое никеля, говорит о сохранении целостности графена и позволяет утверждать, что произошло внедрение золота между графеном и поверхностью Ni(111).

На рисунке За представлен атомно-разрешенный СТМ-кадр поверхности N-Gr/Au/Ni(111) с однородной сетью треугольных петлевых дислокаций. Обработка СТМ-изображений дает период сети треугольных петлевых дислокаций  $10.9 \pm 1.5$  в параметрах решетки Ni(111). Это означает, что Au находится в интерфейсе Gr/Ni(111) в виде монослоя чистого золота или слабо разбавленного Au-Ni (в основном, золото) сплава согласно работе [24]. Для сравнения с СТМизображением N-Gr/Au/Ni(111) на рис. 3b приведено СТМ-изображение поверхности Gr/Au/Ni(111), аналогичное полученному нами в работе [8].

В работе [25] спектральными методами показано, что после интеркаляции золота под N-графен на поверхности Ni(111), полученный CVD-методом из молекул триазина, атомы азота, ранее встроенные в графен, сохраняются. Действительно, на рис. За наблюдаются локальные атомные структуры с характерными интерференционными максимумами в структуре C(0001)- $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ -30°. На вставках к рис. За, b показаны соответствующие Фурье-образы СТМ-изображений.

После интеркаляции золота в N-Gr/Ni(111) измеренный оже-сигнал от азота был на уровне шума. Тем не менее, мы считаем, что уровень легирования графена азотом остался достаточно высоким. Основанием для этого является наличие атомных центров рассеяния, наблюдаемых в СТМ-кадрах поверхности графена после интеркаляции золота (рис. 3а). Ранее нами было установлено [8], что для случая нелегированного графена, полученного при TPGсинтезе из пропилена, концентрация дефектов после интеркаляции золота сильно падает в сравнении с исходной (около 1%, Ni-V центры) и становится меньше 0.02 %. После интеркаляции золота в N-Gr/Ni(111) концентрация дефектов равна  $\approx 0.3$ %, что на порядок превышает характерную остаточную концентрацию дефектов для нелегированного графена и не противоречит оценке исходной концентрации азота в N-Gr/Ni(111) до интеркаляции, составляющей не менее 0.1 %. Таким образом, мы полагаем, что большая часть центров электронного рассеяния, наблюдаемых в СТМ-кадрах, обусловлена внедрением атомов азота в решетку графена.

Наблюдаемые в СТМ-кадрах центры электронного рассеяния в N-Gr/Au/Ni(111) можно разделить на следующие типы (рис. 3a): А – центр в виде трехлучевой звезды; В – центр в виде ассиметричной двухлучевой звезды, где один луч практически не наблюдается; С – центр с квадратной симметрией и центр D. Интерференционная картина центра А может быть обусловлена или единичной вакансией в графене, или замещением атома углерода атомом азота, или пиридиновым центром [26, 27]. Мы исключаем одиночную вакансию, поскольку отдельных вакансий при TPG-синтезе Gr/Au/Ni(111) из молекул пропилена практически не наблюдалось. Возможность формирования пиридинового центра N-V в процессе интеркаляции золота нами не исключается, хотя наиболее вероятным источником полносимметричной картины интерференции является 1Nfcc-центр, наблюдаемый в исходной структуре N-Gr/Ni(111) (см. рис. 2). Структура центра В, в соответствие с данными работ [27, 28], хорошо объясняется замещением двух ближайших атомов углерода из одной подрешетки графена атомами азота. Центр С можно интерпретировать как замещение двух ближайших атомов углерода из разных подрешеток графена атомами азота [26, 27]. Центр D ранее наблюдался в работе [26], но своей интерпретации не получил. Мы также пока затрудняемся дать интерпретацию центра D. Более детальный анализ структуры всех наблюдаемых N-центров как до, так и после интеркаляции золотом мы планируем сделать при пониженных температурах (LN<sub>2</sub> или LHe) методами сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии.

Таким образом, нами предложен и реализован новый способ синтеза азотированного графена методом TPG из ацетонитрила. Данный метод позволяет формировать на всей поверхности Ni(111) сплошной эпитаксиальный монослой углерода в структуре графена с внедренными атомами азота. Сравнение экспериментальных и модельных СТМ-изображений наблюдаемых локальных атомных структур дает основания полагать, что семейство азотных центров в монослое углерода достаточно большое и может включать в себя как одноатомные, так и двух- и трехатомные образования. Интеркаляция золота под монослой углерода позволяет сохранять азотные центры, снимая гибридизацию π-состояний графена и d-состояний никеля. Также установлено, что в интерфейсе N-Gr/Ni(111) интеркалированное золото находится в виде монослоя чистого золота или слабо разбавленного Au-Ni (в основном, золото) сплава. Концентрация азотных центров на поверхности N-графена после интеркаляции золота (не более 0.3%) по порядку величины совпадает с концентрацией азотных дефектов в N-графене/Ni(111) (не менее 0.1%). Если считать, что в среднем азотный центр содержит два атома азота, то концентрация азота в графене находится в диапазоне от 0.2 до 0.6%.

Работа поддержана Российским научным фондом (грант # 16-12-00050).

Авторы выражают благодарность Межведомственному суперкомпьютерному центру РАН за предоставление вычислительных ресурсов.

- K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. Grigorieva, and A.A. Firsov, Science **306**, 666 (2004).
- K.S. Novoselov, D. Jiang, F. Schedin, T.J. Booth, V.V. Khotkevich, S.V. Morozov, and A.K. Geim, Proc. Natl. Acad. Sci. USA (PNAS) 102, 10451 (2005).
- K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, M. I. Katsnelson, I. V. Grigorieva, S. V. Dubonos, and A. A. Firsov, Nature 438, 197 (2005).
- А. А. Артюх, Л. А. Чернозатонский, Письма в ЖЭТФ 111, 93 (2020).
- A.C. Ferrari, F. Bonaccorso, V. Fal'ko et al. (Collaboration), Nanoscale 7, 4598 (2015).
- H. Xu, L. Ma, and Z. Jin, Journal of Energy Chemistry 27, 146 (2018).

- С. Л. Коваленко, Т. В. Павлова, Б. В. Андрюшечкин, К. Н. Ельцов, Письма в ЖЭТФ 105, 170 (2017).
- K. N. Eltsov, S. L. Kovalenko, T. V. Pavlova, and B. V. Andryushechkin, *Atomically Controlled Surfaces Interfaces and Nanostructures*, ed. by A. Bianconi and A. Marcelli, Superstripes Press, Rome (2016), Science Series, v. 9, p. 37.
- 9. T.V. Pavlova, S.L. Kovalenko, and K.N. Eltsov, J. Phys. Chem. C **124**, 8218 (2020); https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b11942.
- C. M. Friend, E. L. Muetterties, and J. L. Gland, J. Phys. Chem. 85, 3256 (1981).
- J. C. Hemminger, E. L. Muettertie, and G. A. Somorjai, JACS **101**, 62 (1979).
- A. Varykhalov, J. Sanchez-Barriga, A. Shikin, C. Biswas, E. Vescovo, A. Rybkin, D. Marchenko, and O. Rader, Phys. Rev. Lett. **101**, 157601 (2008).
- 13. G. Kresse and J. Hafner, Phys. Rev. B 47, 558 (1993).
- G. Kresse and J. Furthmüller, Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).
- J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- 16. S. Grimme, J. Comput. Chem. 27, 1787 (2006).
- D. E. P. Vanpoucke and G. Brocks, Phys. Rev. B 77, 241308 (2008).
- J. Tersoff and D. R. Hamann, Phys. Rev. B 31, 805 (1985).
- Y. Bai, D. Kirvassilis, L. Xu, and M. Mavrikakis, Surf. Sci. 679, 240 (2019).

- 20. Е.В. Рутьков, Е.Ю. Афанасьева, Н.Р. Галль, Письма в ЖЭТФ **111**, 520 (2020).
- T. Jach and J.C. Hamilton, Phys. Rev. B 26, 3766 (1982).
- P. Jacobson, B. Stger, A. Garhofer, G.S. Parkinson, M. Schmid, R. Caudillo, F. Mittendorfer, J. Redinger, and U. Diebold, ACS Nano 6, 3564 (2012).
- T. V. Pavlova, S. L. Kovalenko, B. V. Andryushechkin, G. M. Gidomirov, and K. N. Eltsov, Physics of Wave Phenomena 28(3) (2020), in press.
- J. Jacobsen, L. P. Nielsen, F. Besenbacher, I. Stensgaard, E. Lægsgaard, T. Rasmussen, K. W. Jacobsen, and J. K. Nørskov, Phys. Rev. Lett. **75**, 489 (1995).
- D. Usachov, O. Vilkov, A. Grüneis, D. Haberer, A. Fedorov, V.K. Adamchuk, A.B. Preobrajenski, P. Dudin, A. Barinov, M. Oehzelt, C. Laubschat, and D. V. Vyalikh, Nano Lett. **11**, 5401 (2011).
- 26. F. Joucken, Ya. Tison, J. Lagoute, J. Dumont, D. Cabosart, B. Zheng, V. Repain, C. Chacon, Ya. Girard, A.R. Botello-Méndez, S. Rousset, R. Sporken, J.-C. Charlier, and L. Henrard, Phys. Rev. B 85, 161408 (2012).
- M. Telychko, P. Mutombo, M. Ondráček, P. Hapala, F. C. Bocquet, J. Kolorenč, M. Vondráček, P. Jelínek, and M. Švec, ACS Nano 8, 7318 (2014).
- P. Jacobson, B. Stöger, A. Garhofer, G.S. Parkinson, M. Schmid, R. Caudillo, F. Mittendorfer, J. Redinger, and U. Diebold, ACS Nano 6, 3564 (2012).